問題5

I. 電子のふるまいを記述する1次元のシュレディンガー方程式は、次式で表される.

$$i\hbar\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t)$$

ここで、 $\psi(x,t)$ は電子の波動関数で位置xと時間tの関数、V(x)はポテンシャルで位置xの関数、mは電子の質量、hはプランク定数hを 2π で割ったもの、iは虚数単位である。以下の問に答えよ。

(1) エネルギー固有状態の波動関数は,

$$\psi(x,t) = \Phi(x)e^{-i\omega t}$$

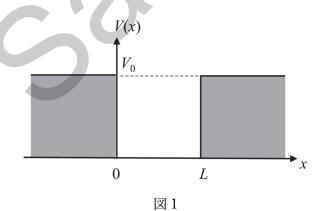
と表すことができる。 $\phi(x)$ はxの関数、 ω は角振動数である。これを用いて時間に依存しないシュレディンガー方程式を導出せよ。

(2) 図1に示すポテンシャルV(x)で閉じ込められた電子のエネルギー固有状態を考える. ここで、 $0 \le x \le L$ のとき V(x) = 0, x < 0 および L < x のとき $V(x) = V_0$ である. ポテンシャルの高さ V_0 が無限大のとき, $0 \le x \le L$ の範囲に存在する $\Phi(x)$ の解は

$$\Phi(x) = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx}$$

で与えられる. ただし、kは波数で正の実数、 C_1 、 C_2 は定数である. なお、 x < 0、L < x で $\Phi(x) = 0$ とする.

- (2-i) 電子のエネルギー固有値Eをkを用いた式で表せ.
- (2-ii) kの値を求め、エネルギー固有値Eを求めよ.
- (2-iii) 上記で求めた各エネルギー固有値に対応する電子の固有関数を求めよ.



(3) 図1でポテンシャルの高さ V_0 が有限の場合を考える. ここで, $V_0 > E$ のとき, ポテンシャル障壁に閉じ込められた電子の波動関数 $\Phi(x)$ の解は,

$$\Phi(x) = \begin{cases} B_1 e^{k'x} & x < 0 \\ C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx} & 0 \le x \le L \\ B_2 e^{-k'x} & L < x \end{cases}$$

で与えられる. ただし、k'は正の実数であり、 $k' = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$ である. B_1 , B_2 , C_1 , C_2 は定数である. (3-i) ポテンシャル障壁への波動関数のしみ出し(侵入長)はどうなるか、k'を用いて記述せよ.

- (3-ii) V_0 が無限大のときには、ポテンシャル障壁への波動関数のしみ出しがない。その物理的理由を述べよ
- (3-iii) V_0 が無限大のときと有限のときでは電子の基底状態のエネルギー固有値にどのような違いが生じるか. また, 励起状態ではその違い (V_0 が無限大のときと有限のときのエネルギー固有値の差) が基底状態と比べてどうなるかを述べよ. ここで, V_0 が有限のときの電子の波動関数やエネルギー固有値を厳密に求める必要はない.
- (3-iv) 図1に示すポテンシャルV(x)に閉じ込められた電子系で、基底状態のみに電子が存在するとき、光を照射すると基底状態から励起状態への遷移が起こり得る(半導体の量子井戸構造ではこれをサブバンド間遷移と呼ぶ). V_0 を無限大から有限の高さに変えたとき、サブバンド間遷移の光エネルギーと波長がどう変わるかを述べよ. ここで、 V_0 が有限のときの電子の波動関数やエネルギー固有値を厳密に求める必要はない.

II. 3次元半導体結晶である真性半導体の伝導帯と価電子帯を考える。伝導帯下端のエネルギーを $E_{\rm C}$,価電子帯上端のエネルギーを $E_{\rm V}$,フェルミ準位を $E_{\rm F}$,電子の有効質量を $m_{\rm e}$,正孔の有効質量を $m_{\rm h}$,禁制帯幅(バンドギャップ)を $E_{\rm g}$,絶対温度をT,ボルツマン定数を $k_{\rm B}$,プランク定数をh,hを 2π で割ったものをhとする。この半導体では,禁制帯幅は $1\,{\rm eV}$ 程度であり,電子,正孔ともにそれぞれ一種類のバンドのみを考え,キャリアは Γ 点(波数ベクトル k=0)付近のみに存在し,有効質量近似が成り立つものとする。以下の間に答えよ。

- (1) 伝導帯の電子の運動エネルギーEを波数ベクトルkの関数として表せ.
- (2) 伝導帯の電子の状態密度 g(E) は次式で表される. これを導出せよ.

$$g(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} (E - E_C)^{\frac{1}{2}}$$

(3) 室温付近で熱平衡状態の半導体の伝導帯に存在する電子密度 n_0 を、 E_C 、 E_F 、 m_e 、T、 k_B 、hを用いて表せ、ただし、フェルミ・ディラック分布はボルツマン分布で近似できるとする。導出に際して、以下の公式を利用してもよい。

$$\int_0^\infty \sqrt{x} \exp\left(\frac{-x}{k_{\rm B}T}\right) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi (k_{\rm B}T)^3}$$

- (4) 室温付近のフェルミ準位EFを求めよ.
- (5) この半導体がSi(シリコン)である場合、N型あるいはP型にするにはそれぞれどのような不純物を添加すればよいか、元素名を1つずつ挙げ、その元素を選んだ理由を述べよ。また、真性半導体からN型あるいはP型にした場合に、フェルミ準位 E_F はそれぞれどのように変化するか。以上を5行程度で説明せよ。必要に応じて図を用いてもよい。